

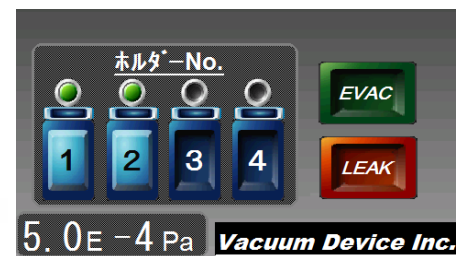


TVS-40T 形

# TEM ホルダー保管装置

4本独立の排気操作が可能な真空保管装置

- 本装置は TEM ホルダー4本をオイルフリー真空下で保管する装置です。
- 本装置を使用することにより、コンタミネーションの付着を大幅に減らすことが可能です。
- 独立した真空室に保管するため、個別に出し入れが可能です。
- TEM ホルダーポートはお客様のお使いの TEM ホルダーに合わせて製造いたします。
- 各ホルダー試料部が見られるガラス窓付き(NW40フランジ)



操作画面

## 操作性

- タッチパネル搭載で操作も簡単。
- プログラム制御による自動排気シーケンスやインターロック制御を搭載。
- ポンプのメンテナンス時期を画面に表示してお知らせいたします。

株式会社 真空デバイス

〒311-4155 茨城県水戸市飯島町 1285-5

TEL.029-212-7600 FAX.029-212-7601

URL : <https://www.shinkuu.co.jp>

E-mail : [device@shinkuu.co.jp](mailto:device@shinkuu.co.jp)

## 仕 様

- 排 気 系 : 67L/secターボ分子ポンプ、20L/minダイヤフラムポンプ  
オプションのプラズマクリーナー付属時はスクロールポンプ付属
- 真空度測定: フルレンジ真空計
- 到達真空度:  $5 \times 10^{-4}$  Pa以下
- 装置サイズ: W585mm X D555mm~ X H395mm、30Kg  
(D寸法はTEMホルダーにより異なります)
- 電 源 : AC100V(単相100V)10A , アース線付3芯プラグ使用  
オプションのプラズマクリーナー付属時はAC100V(単相100V)15A
- リーク用ガス:  $\phi 1/4$ インチ swagelok 接続  
(N2パージ使用時最大圧力:0.03MPa)
- 特別注文・改造につきましては、都度ご相談下さい。

## オ プ シ ョ ン

### ランプ加熱ユニット

- ・ 加熱方式: 集光凹面鏡レンズ付ハロゲンランプによる加熱。
- ・ 放熱方式: ファンによる空冷放熱。
- ・ 温度制御: 熱電対測温PID制御、電子タイマースイッチ付。
- ・ 制御電源サイズ: 280 W x 450D x 185 H

### プラズマクリーニング ユニット

- ・ 電 源 : AC100V(単相100V)3A, アース線付3芯プラグ使用
- ・ クリーニング対象: 電子線照射により堆積したコンタミ除去及び付着防止。
- ・ ガス導入: ニードルバルブマニュアル調整、ガスパージ用電磁バルブ ON/OFF 方式
- ・ プラズマガス: Air・Ar・ArO<sub>2</sub>・他、0.08~0.1 MPa, 1/4 インチチューブ接続
- ・ 安全対策: 系統別ヒューズ採用
- ・ プラズマ電源 : 周波数 13.56 MHz, 出力 0 ~50 W 可変、出力表示 デジタルメータ
- ・ タイマー : 0~1, 2, 3, 12, 30/sec, min, hr 各自由設定. 電子タイマー
- ・ プラズマ電源サイズ : 250W X 300D X 135H 重量 9Kg、プラズマ点火表示ランプ付
- ・ プラズマ銃サイズ : 70mm $\Phi$  X 220L プラズマ銃取付 NW-40

※ランプ加熱及びプラズマクリーニングユニットポートの使用はTEMホルダー形状により制限がございます。  
特に、異なるメーカーホルダーの共用はできません。

### クライオホルダー用排気ユニット

- ・ クライオホルダー一部を排気する機能を追加可能です。
- ・ 接続用変換継手は応相談で製作致します。